

半導体装置製造用

300mm (12inch) ゲートバルブ

For semiconductor manufacturing equipment 300mm (12inch) Gate valve



概要 Overview

カム方式による one-action valve の機構を採用し、コンパクト化、メンテナンス性向上、及び低価格化を実現しました。

The mechanism of one-action valve by a cam system is adopted, and size reduction, improving maintainability, and low-pricing are realized.

特長 Features

- 無摺動機構の採用で、装置内をクリーンな状態に保持いたします。
- 弁板シール部は独自の溝形状により、メタルコンタクトの防止などクリティカルなアプリケーション下でも安定したシール性能を確保いたします。
- 実績豊富なカム方式による駆動方法で、安定したシール性能を確保いたします。
- 自社独自に開発したベローズを搭載し、長寿命に対応した品質と信頼性を確保いたしました。

- The inside of equipment is kept clean by adoption of a non-slide mechanism.
- According to the shape of an original trench, a seal plate secures the seal performance stable also under tough condition, such as prevention from contact of metal.
- The driving method by a cam type with abundant track records secures the stable seal performance.
- The bellows of its company is carried, and the quality and reliability corresponding to a longer operating life are secured.

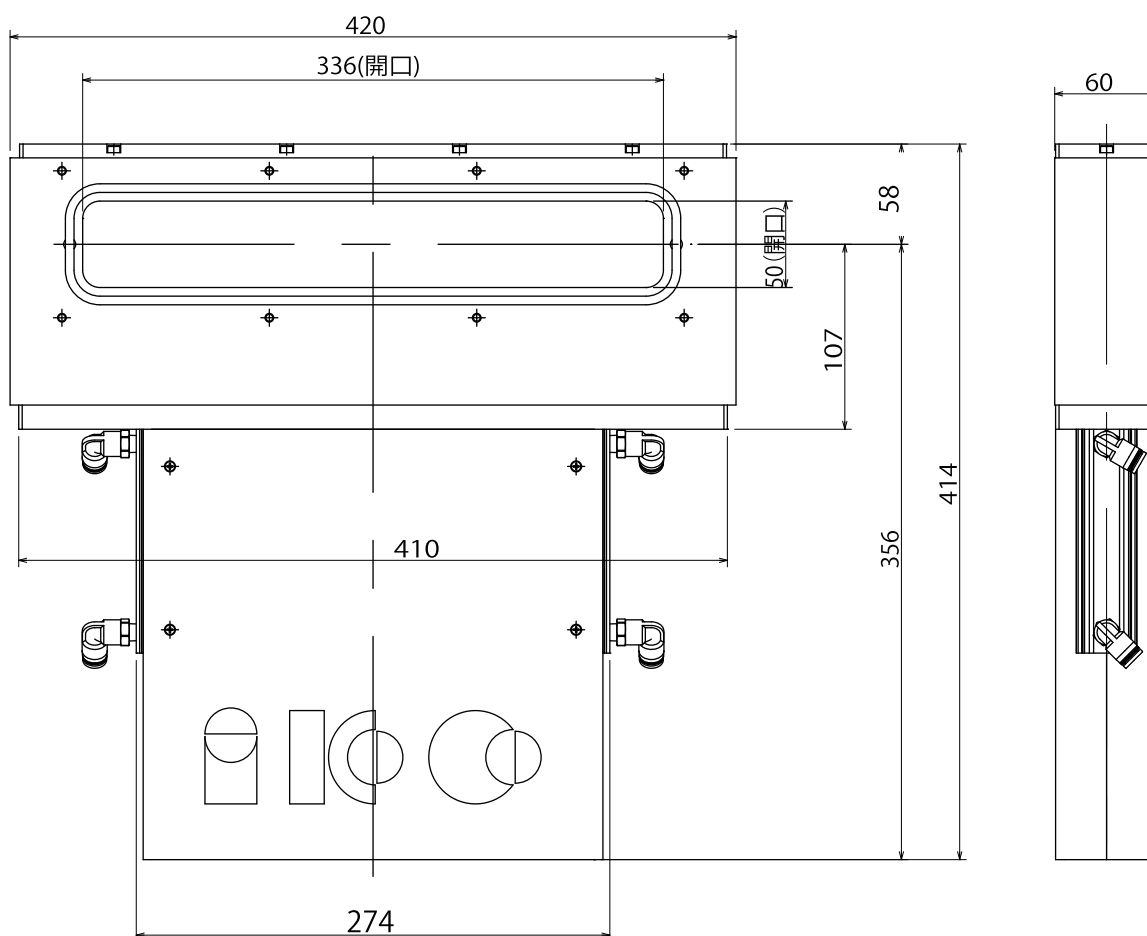
仕様 Specifications

- 使用圧力範囲 : 大気圧 $\sim 1 \times 10^{-6}$ Pa
- ヘリウムリーク量 本体 : 1×10^{-10} Pa $\cdot$ m³/s 以下
弁板 : 5×10^{-10} Pa $\cdot$ m³/s 以下
- 対応差圧力 : 正圧 同圧 逆圧
- メンテナンスサイクル : 1×10^6 回 (弁板 O-Ring は除く)
- 材質 (弁箱・弁板) : SUS 又は A5052

- Pressure range : Atmospheric pressure $\sim 1 \times 10^{-6}$ Pa
- He leak rate (Gate valve) : MAX. 1×10^{-10} Pa $\cdot$ m³/s
(Seal plate) : MAX. 5×10^{-10} Pa $\cdot$ m³/s
- Differential pressure : Positive pressures, Equal pressures, Negative pressures
- Maintenance cycle : 1×10^6 cycles
(This does not apply to O-ring of seal plate)
- Material : SUS or A5052 (Valve casing, Seal plate)

入江工研株式会社

外観図 Schematic diagram



- 本社 Head Office 〒 100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 414
HibiyaKokusai-bldg 414, 2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0011
TEL : 03-3507-9611 FAX : 03-3507-9615
- 大阪営業所 Osaka Office 〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 1-2-11 大同生命南館
Daido Seimei Minami-Kan 1-2-11 Edobori, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0002
TEL : 06-6445-2630 FAX : 06-6459-3350
- 工場 Factory テクニカルセンター (埼玉県), 内子工場・中山工場 (愛媛県)
Technical Center (Saitama-ken), Uchiko Factory・Nakayama Factory (Ehime-ken)

